

両面同時露光マスクアライナー

# BS620

φ6インチ  
対応

ウェハ表裏同時露光  
セミオート動作で中ロット生産に対応

## 大型試料対応両面同時露光機

1968年以来ベストセラー両面同時露光マスクアライナーBSシリーズのφ6インチウェハ対応機です。各種研究開発から水晶発振子、センサ、LED、電力デバイス、通信デバイスの小中ロット製造用として多くの稼働実績があります。一次露光は両面同時、二次露光以降は片面ずつ露光する方法を採用しシンプルで応用が利くモデルです。各種ニーズに合わせたカスタマイズも承ります。

### 特徴

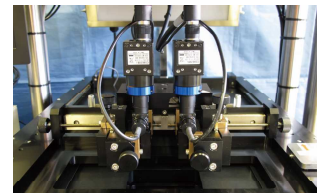
- ◆ランプハウス2基搭載でウェハ表裏同時露光（一次露光のみ）デバイス製造プロセスを効率化。
- ◆最大φ6インチウェハ対応
- ◆試料、マスクの密着性を改善する試料吹上コンタクト機能（片面露光時）
- ◆上下マスクアライメント時に下方からの透過式照明が利用可能
- ◆露光時の待避が容易な前後スライド式アライメント顕微鏡
- ◆フットスイッチにより簡単に操作できるセミオート運転モード
- ◆ランプ交換の容易なフロントスライド式下側ランプハウス
- ◆レベル（平行出し）調整が容易な球面フローティング機能
- ◆コンパクト設計

### 主な仕様

- ①適用試料 最大φ6インチ
- ②適用マスク 最大□7インチ マスク・ウェハサイズ変更は上下マスクホルダー交換
- ③露光性能 有効露光範囲 φ160mm Hgランプ250W
- ④UV照度 7mW/c㎡以上 (at365nm) 照度均一度 ±5%以内
- ⑤露光解像度 ライン&スペース3μm \* デバイスの最終加工精度ではありません。
- ⑥露光方式 コンタクト方式（コンタクト圧可変式） ウェハ上面のみプロキシミティ露光可能
- ⑦アライメント方式 双対物2視野顕微鏡による上側マスクパターンと下側マスクパターンまたはウェハ上面同時観察によるマニュアルアライメント。上側マスク位置基準（固定）式。
- ⑧アライメント顕微鏡 双対物カメラ&モニタ観察顕微鏡、10.4インチモニタ×2台  
左右対物レンズ間距離 30~160mm  
観察照明 高輝度赤色LEDによる同軸落射式照明  
上下マスクのアライメント時には下側ランプハウスからの透過光照明も利用可能。
- ⑨マスクアライメントステージ  
X軸（横） ±5mm手動（微動・粗動調整ダイヤル） 微動100μm/回転、粗動800μm/回転  
Y軸（縦） ±5mm手動（微動・粗動調整ダイヤル） 微動100μm/回転、粗動800μm/回転  
Z軸（上下） 0~1mmエア駆動方式（コンタクト圧調整レギュレータ付）  
0~8mm手動メカ駆動方式 ギャップ測長器（分解能1μm）はオプション  
θ軸 ±3°手動（微動）  
平行アジャスト 球面摺動機構（エアフローティングおよび真空ロック付）
- ⑩上側マスク駆動 モーター駆動による前後スライド方式 繰返位置決め X Y θ方向精度±1.5μm以内/100回
- ⑪装置寸法・重量 1645(H)×1114(W)×810(D)mm 突起部含まず 400kg
- ⑫ユーティリティ 電源 AC100V 30A、真空 26.6×10<sup>3</sup> Pa以上 クリーンドライエア 0.6MPa以上



(写真は参考:オプション装備例)



特約店

SANMEI GROUP IDENTITY  
**sanmei** 株式会社 三明

〒424-0825 静岡県静岡市清水区松原町6-16  
電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648

製造元



株式会社 ナノテック  
Nanometric Technology Inc.

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201

www.nanotech-inc.co.jp  
info@nanotech-inc.co.jp

電話(03)3960-3171 Fax (03)3960-3174